氏名 松田 良信	役職 准教授	専門分野 プラズマ理工学
Matsuda Yoshinobu	Associate Professor	Plasma Science and Engineering
1. 主な研究概要	10000000	Thasma Science and Engineering
1. 土な研究協会 我々は、環境に優しい酸化亜鉛系材料をベースにした透明導電膜のスパッタリング成膜プロセス およびプロセスの簡易診断法の開発を研究しています。We are investigating sputtering deposition		
processes for transparent conductive films based on environmentally friendly zinc oxide materials and the		
development of simple diagnostics for the processes. ① 酸化亜鉛系透明導電膜作成プロセス(Zinc oxide-based transparent conductive film manufacturing		
process)		
マグネトロンスパッタリング法、誘導結合プラズマ支援スパッタリング法、軸外しスパッタリン グ成膜法などの種々の方法で、高品質(高光透過率・低抵抗率)な金属添加酸化亜鉛系透明導電 膜の作成プロセスを研究しています。		
We are studying the process of creating high-quality (high light transmittance and low resistivity)		
metal-doped zinc oxide transparent conductive films by various methods such as magnetron sputtering,		
inductively coupled plasma-assisted sputtering, and off-axis sputtering deposition methods. ② コンパクトなプラズマ診断計測法の開発(Development of compact plasma diagnostics)		
成膜プロセスの高度理解と高機能化のために、簡易粒子計測法の開発を行っています。外部共振		
器型ダイオードレーザー(ECDL)を用いたレーザー吸収分光により、プラズマ中の原子の速度		
分布関数を測定し、非侵襲で気体温度を測定できます。また、我々は磁気フィルタ付き反射電界		
型エネルギー分析器(磁化 RFEA)を用いて、プロセス中の正イオンおよび負イオンのエネルギ		
一分布関数を測定し、成膜プロセスの解明と最適化を研究しています。		
We are developing a simple particle measurement method for advanced understanding of the film		
deposition process and for the enhancement of its functionality. Laser absorption spectroscopy using an		
external cavity diode laser (ECDL) allows us to measure the velocity distribution function of atoms in a plasma and non invasivaly measure gas temperature. We also use a retarding field energy analyzer with		
plasma and non-invasively measure gas temperature. We also use a retarding field energy analyzer with magnetic filter (magnetized RFEA) to measure the energy distribution function of positive and negative		
ions in the process to elucidate and optimize the deposition process.		
ions in the process to endendate and optimize the deposition process.		
Tuning Mirror		
Diode Laser	24	
\square θ	正イオン	◎ " → 正イオン
+ h	Grating 負イオン	Agnetic RFEA内部
a state and a	電子	Filter 負イオン
θ_1 γ_{θ_2} l_p		▲ 電子
Pivot Point	X	
Configuration of Littman-ECDL 磁化 RFEA の原理(Principle of magnetized RFEA)		
2. キーワード		
和文:透明導電膜、スパッタリング、プラズマ計測、イオンエネルギー分布関数		
英文: Transparent conductive films, Sputtering, Plasma diagnostics, Ion energy distribution function		
3. 特色・研究成果・今後の展望		
・電流変調 ECDL は小型,軽量のデスクトップレーザーシステムで,電流変調と外部共振器の変調を同期することで,幅広い波長掃引幅での高分解能分光を可能とします。		
・磁化 RFEA により電子と負イオンを分離して、正・負イオンのエネルギー分布関数を測定可能		
ですが、磁界が荷電粒子輸送へ及ぼす影響を定量的に明らかにする必要があります。		
The current-modulated ECDL is a compact, lightweight desktop laser system that enables high-resolution		
spectroscopy over a wide range of wavelength sweep widths by synchronizing current modulation with		
external cavity modulation. Altho	ugh magnetized RFEA can	separate electrons and negative ions and
measure the energy distribution functions of positive and negative ions, the effect of the magnetic field on		
charged particle transport needs to be quantitatively clarified.		
researchman : https://researchman.in/read0172766/		
researchmap : https://researchmap.jp/read0172766/ 研究室 HP: //www.eee.nagasaki-u.ac.jp/labs/plasma/		
<u> </u>		
誰でも気軽に使える安価でコンパクトな簡易計測装置の開発を目指しています。		
Our goal is to develop an inexpensive, compact, simple measuring device that anyone can use easily.		